

K675X
K675XD

デジタル

大型試料用ターボスパッタコーター

チェンバーサイズ 300mm 径 Cr 対応機

EMITECH
sample preparation

K675X は全自動制御により条件（スパッタ電流・処理時間など）を入力することにより、再現性のある均一なコーティングを行うよう設計されました。ターゲットは酸化しにくい金属はそのまま、酸化しやすい金属であるクロムやアルミニウムなどはクリーニング機構によりコーティング前にターゲットシャッターを閉じ、ターゲットクリーニングを行った後、清浄面でコーティングすることができます。

K675X は 300mm 大型チェンバーで試料は最大 200mm まで対応可能です。

クリーンな真空を作り出すターボポンプを組み込み、酸化しやすい金属にも対応するトリプルマグネトロンターゲットヘッドを搭載し、回転試料ステージにより大きな試料も均一なコーティングが行えます。

トリプルマグネトロンターゲットヘッドは異なるターゲットを自動で連続してコーティングをする設定はできません。2種類のターゲットを自動で連続してコーティングしたい場合は K675XD デュアルヘッドシステムをご参照ください。

小さい試料などにはトリプルマグネトロンターゲットヘッドの中からシングルヘッドを選択し効率の良いコーティングを行うことができます。

K675XD

デュアルヘッドシステム(姉妹品)

2つの独立したターゲットヘッドを採用し、異なるターゲットで大気開放をせずに順番にコーティングすることが可能です。試料は最大 150mm まで均一にコーティングが行えます。

K675X の主な機能とメリット

- トリプルマグネトロンターゲットヘッドを搭載：大口径試料に対応。
- ターボポンプシステム：Cr などの酸化しやすいターゲットを、粒状性を保ったままコーティングが可能。
- 完全自動制御：操作メニューがシンプル。
- ペルチェ冷却方式を採用：ターゲットヘッド冷却に専用の冷却水が不要。
- 微細コーティングが可能：Cr ターゲットで粒径は約 0.5nm、超高解像が容易に得られます。
- 独自の試料回転ステージを採用：ダブルアクション機構によりコンパクトであり

ながら大型の試料を最適に回転可能。

- 300mm の大型チェンバーを採用：最大 200mm までの試料を容易に試料ステージに置くことができます。

オプション

- K250 カーボンエバポレーション：シングルタイプのカーボンファイバーまたはカーボンロッドタイプの選択が可能（試料は最大 50mm まで適します）。
- K150X 膜厚計（FTM）
- EK4197：オシレーション / 回転試料ステージ
- EK4200：傾斜 / 回転試料ステージ
- SC7605：カーボンロッドシャープナー
- SEM- ベーシックスターターキット：試料スタブ取付台、収納ケース、マウントメディアやピンセットを含む。



製品仕様

付属品	TK8845 Cr ターゲット ×3、真空ホース 1m、ホース用フィッティング、電源コード、アクセサリパック
電源	100V、最大 20A（ポンプ含む）
試料ステージ	150mm または 200mm ウエハを搭載可能（フレキシブル機構を採用）モーター駆動による回転及びマニュアルのチルト機能
ターゲット	ディスクタイプ 57mm 径 ターゲットの厚みによりバックプレートを取り外すことが可能
オプションターゲット	Cr、Ir、C、ITO、Al、他
重量及び寸法	幅 450mm / 奥行き 500mm / 高さ 300mm（ガラスチェンバー含む：高さ 630mm）、重量：42Kg
排気系	ターボ分子ポンプ 60L/sec を搭載、ロータリーポンプ（オプション 50L/min タイプを推奨）及びオイルミストフィルター ＊クリーンルーム内でのご使用にはオイルフリータイプが選択可能
操作時の真空度	1×10^{-2} mbar から 1×10^{-4} mbar
コーティング時間	0 から 4 分間、Cr ターゲットにて 15nm/min 程度が得られます

スパッタ
コーターグローディス
チャージSEM 用カーボン
エバポレーターTEM/SEM
エバポレータープラズマバレル
リアクターペルチェ冷却
フリーズ
ドライ装置CRYO-SEM
装置冷却水 / 温水
循環装置マイクロウェーブ
プロセッサ真空ポンプ
各種表面分析
コンポーネント
各種

表面分析装置

IR チェンバー
カメラ

反射電子検出器